

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局
特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H05B 33/22, 33/10, G02B 5/20, 5/101, G09F 9/00, 9/321	A1	(11) 国際公開番号 WO99/48338 (43) 国際公開日 1999年9月23日(23.09.99)
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/01289</p> <p>(22) 国際出願日 1999年3月16日(16.03.99)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平10/69146 1998年3月18日(18.03.98) JP</p> <p>(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) セイコーエプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION)[JP/JP] 〒163-0811 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 湯田坂一夫(YUDASAKA, Ichio)[JP/JP] 〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 Nagano, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 稲葉良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 37森ビル803号室 TMI総合法律事務所 Tokyo, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 KR, US, 欧州特許(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54) Title: THIN FILM FORMING METHOD, DISPLAY, AND COLOR FILTER</p> <p>(54) 発明の名称 薄膜形成方法、表示装置およびカラーフィルタ</p> <p>(57) Abstract A method for forming a thin film comprises repeating the step of forming an affinity bank layer (111-11n) of a material (inorganic material such as SiO₂) exhibiting an affinity with a thin film material liquid (130) and the step of forming a nonaffinity bank layer (121-12n) of a material (organic material such as resist) exhibiting a nonaffinity with the thin film material liquid (130) so as to form a bank (110) of alternate affinity bank layers and nonaffinity bank layers, filling the space between the banks with the thin film material liquid (130) by an ink-jet method, and performing heat treatment so as to form thin film layers (131-13n) in order. By performing the steps, the cost necessary for affinity control is reduced, and a multilayer thin film with a uniform thickness is formed.</p>		